

電界放射型走査型電子顕微鏡による材料評価

近年の電子顕微鏡の進化は著しい。特に電界放射型電子銃を搭載した電子顕微鏡の登場で、これまでの評価に比較して効率も精度も著しく向上した。一方で、コンピューターの進化でオペレーションは著しく簡便となった。本研修では、電界放射型走査型電子顕微鏡に関する座学と、名古屋工業大学先進セラミックス研究センターが保有する電界放射型走査型電子顕微鏡を用いた実習(観察と元素分析)で材料評価を体験していただき、今後の研究開発や製品管理に利用いただくことを目指します。

平成31年

3 / 14
(木)

10:00-17:00

座学2時間・実習4時間

開催場所

名古屋工業大学
先進セラミックス研究センター
多治見駅前地区(クリスタルプラザ)
講義室

講習料

100,000円

募集対象者

民間企業の研究者・技術者

募集人員

2名(ただし最大5名まで可能)
(定員になり次第、期限前でもお申込の受付を終了させていただきます。)

申込締切

2月25日(月)17時 必着



電子顕微鏡(SEM) メーカー:日本電子株式会社
型式:JSM-7600F 分解能:1nm
倍率25~1,000,000倍 EDS・STEM対応



国立大学法人名古屋工業大学
先進セラミックス研究センター

申込み・問い合わせ

〒507-0033 岐阜県多治見市本町3-101-1クリスタルプラザ4F TEL 0572-24-8110 FAX 0572-24-8109
E-mail jimu@crl.nitech.ac.jp <http://www.crl.nitech.ac.jp/index-j.html> 【担当】石原